## MIM 型ナノキャビティの固有モード共鳴による表面プラズモン波束の透過強度変調

### Modulation of transmission intensity of surface plasmon wave packet

## by eigenmode resonance in a metal-insulator-metal nano-cavity

# 筑波大物理 <sup>0</sup>伊知地 直樹, 久保 敦

Univ. of Tsukuba, °Naoki Ichiji, Atsushi Kubo

### E-mail: s1820196@s.tsukuba.ac.jp, kubo.atsushi.ka@u.tsukuba.ac.jp

### はじめに

金属-絶縁体-金属(MIM)型構造は、可視-赤外光領域メタマテリアルにおける代表的な メタアトムである。表面プラズモンポラリトン (SPP)に対する Fabry-Perot 型の共鳴器であり、 適切なサイズの構造の組み合わせにより、負の 屈折率<sup>1)</sup>や異常反射素<sup>2)</sup>等の特異な光学現象が 実現している。

本研究では、SPP 波束が MIM ナノキャビテ ィに対して入射した時、キャビティの共鳴が SPP 波束に与える影響を FDTD シミュレーシ ョンと実験的な直接観測によって評価した。 MIMナノキャビティの SPP 波束に対する周波 数フィルタリング効果、波束形状への影響をキ ャビティの構造長 Lを変数として議論する。

#### FDTD シミュレーション

Fig. 1(a)にシミュレーションモデルの全体 像を示す。奥行き  $L=10\sim500$  nm の MIM 構造 を設置した Au 表面に中心波長 800 nm、時間 幅 2 fs の超短パルスによって SPP 波束を励 起・伝搬させ、MIM 構造の前後 3.0  $\mu$  m にお ける透過/反射波の界面垂直方向への電場を記 録した。透過波とスペクトルのピークと反射波 のディップの位置はキャビティの共鳴周波数 と一致し(Fig. 1(b))、MIM キャビティが共鳴 周波数成分を透過する Fabry-perot 型の周波数 フィルターとして機能することを示している。

また、金属/絶縁体界面を伝搬した SPP 波束 は正常分散を反映したアップチャープを有し ており、MIM キャビティで特定のスペクトル 成分が切り出されることにより、時間幅の狭窄 化した波束が透過側に、対応するダークパルス



Fig. 1 (a) Schematic of simulation model. (b) Spectra of the transmitted (blue) and reflected wave (red) (L = 160 nm). (c) Envelope shapes of transmitted (blue) and reflected wave (red).

が反射側に放出される(Fig. 1(c))など、波束 形状の多彩な変化を生じる<sup>3)</sup>。

#### 実験

SPP波束の観測は、Ti:Sレーザーから出力さ れる10 fsパルスを干渉計によって遅延時間  $\tau$ を持ったポンプ-プローブパルス対に整形し、 試料表面に照射することによって行う。ポンプ パルスによってAuリッジ構造で励起された SPP波束は、Au表面を伝搬した後、約半分が MIM構造に入射し、他はMIM構造の無い平坦 部を直進する(Fig. 2(a))。遅延時間  $\tau$  を経て 入射されたプローブパルスと波束の干渉ビー トを色素層を介して蛍光顕微像として取得し (Fig. 2(b))、キャビティの影響を解析した。

Fig. 2(c-d)は構造長190 nm、および130 nm のキャビティにおける蛍光顕微像( $\tau$  = 273 fs) の断面プロファイルである。190 nmキャビテ ィにおいて、キャビティ平面(青)における透過 波は強い強度を持ち、波束の大部分がキャビテ ィを透過していることを示す。対照的に130 nmキャビティにおける透過波強度は平坦面 (赤)と比較して著しく低く、キャビティ長に依 存して透過光強度が大きく低下することを示 している。この結果は、キャビティの共鳴周波 数の変化により、透過スペクトルが大きく変調 するシミュレーションの結果と一致する。

**謝辞**:本研究の試料作製は物質・材料研究機構微細加工プラットフォームで行った。

- [1] G. Dolling, et al., Science, **312**, 892-894 (2006)
- [2] S. L. Sun, et al., Nano Lett., 12, 6223-6229(2012)
- [3] N. Ichiji, et al., Opt. Express, in printing.



Fig. 1 (a) Schematic of experiment model. (b) A frame of time-resolved microscopy image. (c) and (d)A profile of the micrograph image for length of cavity L = 190, 130 nm.